

Питання на екзамен

1. Вакуумна дуга Катодна форма вакуумної дуги Основні характеристики
- 2 Типи катодних плям Рух катодних плям Автостабілізація та магнітна стабілізація
- 3 Стаціонарний прискорювач металевої плазми на основі стаціонарного існування дуги вакуумної дуги
- 4 Вакуумна дуга з контрагованою анодною плямою
- 5 Імпульсні прискорювачі металевої плазми (катодний режим) Основні переваги цього методу отримання плівкових покриттів
- 6 Потужний імпульсний прискорювач, що працює в анодному режимі
- 7 Металізація у вакуумі торцевими плазовими прискорювачами
- 8 Метод конденсації іонним бомбардуванням (Характеристики плазми в установках типу БУЛАТ при нанесення покриттів TiN MoN та ін
- 9 Застосування фокусування плазми в системах нанесення покриттів Магнітні фільтри Проходження плазми через магнітний фільтр
- 10 Процеси конденсації та розпилення Основні параметри, що визначають властивості конденсату легуючих добавок Попереднє чищення поверхонь матеріалів
- 11 Рух плазових потоків у слабо неоднорідному поперечному магнітному полі Поляризація згустку зняття поляризації
12. Дифузія плазми у магнітне поле. Вхід плазового потоку до магнітного поля
- 13 Рух плазми у криволінійному магнітному полі Умова проходження викривленої ділянки
14. Прикордонні шари при взаємодії плазми з поверхнею Електронні прикордонні шари Приклади прикордонних процесів за участю важких частинок
15. Особливості взаємодія потужних плазових згустків з поверхнею Основні фізичні процеси при модифікування поверхні високоенергетичними імпульсними потоками плазми
16. Діелектричний бар'єрний розряд Основні особливості та сфери застосування
- 17 Фокусування пучків заряджених частинок Корпускулярна оптика Електростатичні лінзи Магнітне фокусування
- 18 Плазове фокусування компенсованих іонних (пучків Еквіпотенційні поверхні Фокусна відстань лінзи
- 19 Прискорювачі із замкнутим дрейфом електронів та протяжною зоною іонізації (та їх вольтамперні характеристики, параметри прискореної плазми)